

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第3区分

【発行日】平成26年5月1日(2014.5.1)

【公開番号】特開2014-33335(P2014-33335A)

【公開日】平成26年2月20日(2014.2.20)

【年通号数】公開・登録公報2014-009

【出願番号】特願2012-172611(P2012-172611)

【国際特許分類】

H 03H 9/24 (2006.01)

B 81B 3/00 (2006.01)

B 81C 1/00 (2006.01)

H 03H 3/007 (2006.01)

【F I】

H 03H 9/24 Z

B 81B 3/00

B 81C 1/00

H 03H 3/007 Z

【手続補正書】

【提出日】平成26年3月14日(2014.3.14)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0045

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0045】

図4(a)は、MEMS素子101(図示省略)が備えるMEMS振動子3×の平面図、図4(b)は、図4(a)のE-E断面図、図4(c)は、図4(a)のF-F断面図である。

実施形態2は、開口部50が、ウェハー基板1を平面視したときに、下部電極13eと上部電極14eとが重なる領域Wと重なる第1下地部(窒化膜12)の領域に形成されていることを特徴としている。